J. of Nı ı. مجله علوم و فنون هسته اي
No. 29, pp. 7-16, 2003 شماره ۲۹، صفحات ۱۶- ۷، ۱۳۸۲

توليد پرتوهاي ايكس ترمزي مرجع در آزمايشگاه دزيمتري استاندارد

عبدالرضا سليمانيان*، ارژنگ شاهور، مصطفي غفوري، آنيتا عاليپور
مركز تحقيقات كشاورزي و پزشكي هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، صندوق پستي: ۴۳۹۵ - ۳۱۵۸۵، كرج- ايران

چكيده: توليد باريكه هاي مرجع پرتوهاي يونساز با انرژي و دُز مشخّص، در آزمايشگاههاي دزيمتري استاندارد از اهميّت كاربردي زيادي برخوردار است. استانداردهاي معيّني در زمينة معرّفي و نحوة توليد اين پرتوها، توسّط سازمانهاي بين المللي ذيربط، از جمله ISO و IAEA تدوين و منتشر شده اند. در اين مقاله چگونگي توليد و تعيين مشخّصات بخشي از باريكه هاي پرتو ايكس مرجع در سطح پرتودرماني و حفاظت در برابر پرتوها را با استفاده از يك دستگاه مولّد ايكس نوع Philips RT250 و براساس استانداردهاي بين المللي موجود شرح داده و سعي كرده ايم تا پرتوهاي ايكس حاصل در حدّ امكان نزديك به پرتوهاي ايكس مرجع و استاندارد باشند.

واژه هاي كليدي: *سنجه بندي، باريكه ايكس مرجع، كيفيت باريكه، صافي ذاتي، صافي جاذب، ضريب همگني*

Production of Reference Bremsstrahlung X-Radiations for Calibration of Dosimeters at Radiotherapy and Radiation Protection Levels

A. Solimanian*, A. Shahvar, M. Ghafoori, A. Alipoor
Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine, AEOI, P.O.Box: 31585-4395, Karaj-Iran

Abstract: Reference x-radiations are of practical importance at the standard dosimetry laboratories. The specifications and the operational conditions required to produce reference x-radiations are described in the relevant standards, provided by the International Standards Organization (ISO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). In the present work, an x-ray generator, Philips RT250, has been used to produce medium energy reference filtered x-radiations. Attempts have been made to make the characteristics of the produced x-rays as close as possible to those of the standard beams.

Keywords: *calibration, Reference X-radiation, HVL, inherent filteration, absorber, homogeneity coefficient*

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۱/۸/۱۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۲/۷/۲۱
*email: abdolreza_solimanian@yahoo.com

۱- مقدمه

میدانهای مرجع پرتوهای یونساز مبنای سنجه‌بندی و تعیین پاسخ دزیمترها بر حسب نوع و انرژی پرتو به شمار می‌روند. مشخّصات و نحوهٔ ایجاد میدانهای مرجع مناسب برای سنجه‌بندی انواع دزیمترهای مورد استفاده در پرتودرمانی و حفاظت در برابر پرتوها، توسّط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان استاندارد جهانی (ISO) تعیین شده‌اند [۳ - ۱]. تولید میدانهای مرجع پرتوهای یونساز مستلزم دسترسی به منابع مولّد آنها، مانند دستگاههای مولّد پرتو ایکس و چشمه‌های پرتوزا است. در واقع میدانهای فوتونی مرجع مورد نیاز برای سنجه‌بندی دزیمترهای فوتون بر حسب کِرمای[۱] هوا یا واحدهای معادل دُز و تعیین پاسخ آنها بر حسب انرژی فوتون را می‌توان برحسب منشأ تولید آنها در سه دستهٔ کلّی طبقه‌بندی کرد: دستهٔ اوّل پرتوهای ایکس با طیف پیوسته تابش ترمزی[۲] هستند که به وسیلهٔ دستگاههای مولّد پرتوهای ایکس با ولتاژ بین ۱۰ kV تا ۳۰۰ kV تولید می‌شوند و با گذراندن آنها از صافی مناسب، که موضوع این کار تحقیقی است، می‌توان به باریکه‌های ایکس مرجع و استاندارد دست یافت. دستهٔ دوّم، عبارتند از پرتوهای ایکس مشخّص (فلورسنت) یا باریکه‌های فوتون تک انرژی که با تاباندن پرتوهای ایکس ترمزی حاصل از یک لامپ مولّد پرتو ایکس به چند صفحهٔ فلّزی خاص (تابش کننده‌ها)[۳] تولید می‌شوند و در برخی از آزمایشگاههای دزیمتری به عنوان پرتوهای ایکس مرجع با انرژی کمتر از ۱۰۰ keV بکار می‌روند. دستهٔ سوّم، فوتون‌هایی هستند که یا از چشمه‌های پرتوزای مشخّصی مانند (^{60}Co, ^{137}Cs, ^{241}Am) ساطع می‌گردند، یا به وسیلهٔ واکنش‌های هسته‌ای تولید می‌شوند. روش تولید فوتون‌های مرجع در گسترهٔ انرژی بین ٤ MeV و ۹ MeV به وسیلهٔ تعدادی واکنش‌های هسته‌ای خاص توسّط ISO عرضه شده است. انتخاب چنین گسترهٔ انرژی بدین سبب است که اوّلاً میدانهای فوتونی با انرژی حدود ٦ MeV در بسیاری از تأسیسات هسته‌ای (به ویژه در رآکتورها) و منابع دیگر تولید انرژی بالا ایجاد می‌شوند. ثانیاً هیچگونه ناپیوستگی در تغییرات پاسخ بیشتر دزیمترها در این گسترهٔ انرژی و بالاتر از آن دیده نمی‌شود. با وجود این، تولید فوتون‌های مرجع به وسیلهٔ واکنشهای هسته‌ای مستلزم داشتن امکانات و تجهیزات پیچیده‌ای است که بسیاری از آزمایشگاههای دزیمتری فاقد آن هستند.

موضوع این کار پژوهشی، بهینه‌سازی خروجی یک دستگاه مولّد پرتو ایکس برای تولید پرتوهای ایکس مرجع است به طوری که کیفیتهای مناسب سنجه‌بندی دزیمترهای مختلف در سطوح پرتودرمانی و حفاظت در برابر پرتوها را دارا باشند. دستگاه مولّد پرتو ایکس موجود در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL)، دستگاهی از نوع Philips RT250 است که پرتوهای ایکس متوسّط را در پنج ولتاژ ثابت ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوولت تولید می‌کند. این دستگاه، گرچه مشخّصات یک دستگاه مولّد پرتو ایکس مرجع مطلوب، یعنی امکان تغییر پیوستهٔ ولتاژ با دقّت ±۱٪ ، قابلّیت تثبیت ولتاژ دلخواه با دقّت ±۰/۳٪ و یا تغییر پیوستهٔ جریان لامپ در یک گسترهٔ دلخواه را ندارد، ولی با استفاده از امکانات موجود سعی شده است کیفیت پرتوهای ایکس تولید شده در حدّ امکان نزدیک به کیفیت پرتوهای ایکس مرجع و استاندارد باشد.

۲- روش كار

براي توليد باريكه‌هاي ايكس مرجع، انتخاب ولتاژ، انتخاب صافي اضافي مناسب، تعيين كيفيت باريكه و اندازه‌گيري خروجي (نرخ كِرماي هوا) در نقطة سنجه‌بندي مورد نظر بوده است. انتخاب ولتاژ و صافي اضافي اصولاً بايد بر اساس استانداردهاي موجود باشد، ولي، به طوري كه در مقدمه بيان شد، دستگاه مولّد ايكس Philips RT250 تنها در پنج ولتاژ ثابت كار مي‌كند و استفاده از آنها اجتناب ناپذير بوده است. صافي اضافي، ضخامتي متشكّل از يك يا چند فلز معيّن است كه در مسير پرتو قرار داده مي‌شود و با توجّه به ولتاژ اعمال شده، باريكة ايكس با كيفيت مشخّص را توليد مي‌كند. كيفيت باريكة ايكس را با كميتي به نام "لاية نيم‌مقدار" (HVL)[٤] مي‌سنجند. منظور از لاية نيم‌مقدار ضخامتي از يك فلز است كه شدّت باريكة پرتو ايكس (تعداد فوتون‌ها) را پس از عبور از آن به نصف كاهش دهد و آنرا HVL اوّل مي‌نامند. ضخامتي از همان فلز كه بتواند به ضخامت فلز اوّل اضافه شود و شدّت همان باريكه را به ١/٤ كاهش دهد HVL دوّم مي‌نامند. نسبت HVL اوّل به دوّم را ضريب همگني باريكة پرتو ايكس «h» مي‌نامند. با توجّه به اينكه پرتوهاي ايكسي كه طيف پيوستة ترمزي دارند با عبور از صافي همواره سخت‌تر مي‌شوند، بنابراين، اندازه‌گيري HVL دوّم و برآورد h (ضريب همگني)، كه ملاكي از پهناي طيف باريكة پرتو ايكس توليد شده است، در مورد پرتوهاي ايكس در سطح پرتودرماني مطلوب است ولي در سطح حفاظت در برابر پرتوها، به منظور مقايسه با همگني پرتوهاي مرجع، ضرورت دارد.

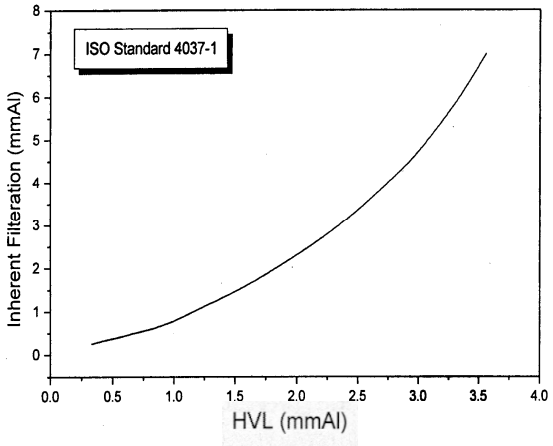
براي تعيين كيفيت باريكه‌هاي ايكس، شدّت عبور پرتو از صافي‌هاي آلومينيومي و مسي (صافي‌هاي جاذب A در شكل ١) با ضخامتهاي مختلف به وسيلة اتاقكهاي يونش اندازه‌گيري شده است. براي رسيدن به كيفيتهاي مرجع و استاندارد ايجاب مي‌كرد كه با هر ولتاژ، تركيب و ضخامت صافي‌هاي اضافي را به دفعات تغيير داده و اندازه‌گيري كيفيت انجام شود. لامپ دستگاه مولّد پرتو ايكسPhilips RT250، كه در هنگام كاربرد باليني روي يك پايه سوار و به لحاظ سهولت حركت قابل انعطاف است، در آزمايشگاه دزيمتري استاندارد (SSDL)، با يك كوليماتور (C) و يك شاتر (S) درون محفظة سربي به ابعاد ٤٥cm×٤٧cm×٧١cmتثبيت شده و باريكه‌هاي مخروطي پرتوهاي ايكس را در طول اتاقي به ابعاد ٤m ×m ٧× ١٤m ايجاد مي‌نمايد. فاصلة محور مركزي باريكه تا كف اتاق ١٢٣ cm و قطر ميدان پرتو، به وسيلة ديافراگم‌هاي D1 و D2 قابل تغيير است. محور مركزي باريكة پرتو، همچنين فاصلة هر نقطه روي محور مركزي باريكه تا كانون پرتو ايكس به ترتيب به وسيلة باريكه‌هاي ليزرL1 (ثابت) و L2 (متحرك) تعيين مي‌شوند (شكل١). جاي صافي اضافي ($F_{add.}$) بلافاصله پس از ديافراگم ثابت خروجي پرتو از محفظة سربي (D_0 = ٨ cm قطر به اوّليه ديافراگم) بوده و صافي‌هاي جاذب (A) نيز، كه هنگام تعيين كيفيت به كار مي‌روند، يا پس از ديافراگم‌هاي متغيرD1 و D2 (در فواصل اندازه‌گيري نزديك،

شكل ١- تركيب‌بندي استفاده شده به منظور به دست آوردن و اندازه‌گيري پرتوهاي ايكس مرجع مورد نظر شاملC:كليماتور S:شاتر F_{add}:صافي اضافي D_0:ديافراگم اوّليه D1 و D2: ديافراگم‌هاي متغيّر A:صافي جاذب IC:اتاقك يونش L1:ليزر ثابت معرّف مركز ميدان پرتو L2:ليزر متحرّك تعيين فاصله XRT:لامپ مولّد پرتوهاي ايكس

cm ۱۰۰- ۷۵) و يا بين آنها (در فواصل دورتر) قرار مي‌گيرند.

۳- اندازه‌گيري ضخامت صافي ذاتي لامپ مولّد پرتو ايكس

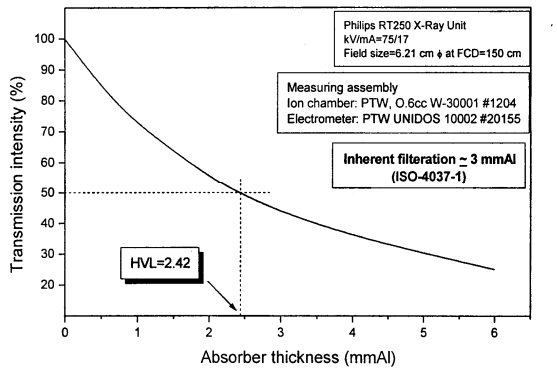
پرتوهاي ايكس قبل از به كار بردن هرگونه صافي اضافي، به وسيلة مواد متشكّلة لامپ مولّد پرتو، از جمله شيشه و روغن خنك‌كننده، تا حدودي تصفيه مي‌شوند. اندازه‌گيري ضخامت اين صافي، كه "صافي ذاتي" ناميده مي‌شود، براي اطمينان از وضعيت رضايتبخش كاركرد لامپ مولّد پرتو ايكس به منظور استفاده از آن در دزيمتري و سنجه‌بندي ضرورت دارد. بر اساس استاندارد ISO-4073-1، ضخامت "صافي ذاتي" لامپ دستگاه مولّد پرتو ايكس مورد استفاده نبايد از معادل ۳/۵ mmAl تجاوز كند. براي تعيين "صافي ذاتي"، توصيه شده است كه كيفيت پرتو ايكس را در ولتاژ ۶۰ kV (بدون بكار بردن صافي اضافي ديگر) اندازه‌گيري كرده سپس با مراجعه به داده‌هاي ارائه شده در استاندارد مذكور، كه ضخامت "صافي ذاتي" را برحسب



تغييرات اندك آن در مقايسه با صافي‌هاي اضافي، همان مقدار تعيين شده در kV ۶۰ به كار مي‌رود. چون پايين‌ترين ولتاژ كار مولّد پرتو ايكس Philips RT250، kV ۷۵ است، براي تعيين صافي ذاتي آن، كيفيت پرتو ايكس در اين ولتاژ اندازه‌گيري شده است. در اين اندازه‌گيري، اتاقك يونش نوع W-30001، cc 0.6، PTW در فاصلة ۱۵۰ سانتي‌متري كانون پرتو ايكس بكار رفته و ديافراگم‌هاي D1 و D2 طوري انتخاب شده‌اند كه قطر ميدان در اين فاصله ۶/۲ سانتي‌متر باشد (به طور كلي در اندازه‌گيري‌هاي مربوط به تعيين كيفيت پرتوهاي ايكس، ابعاد ميدان پرتو بايد طوري انتخاب شود كه براي پوشش كامل و يكنواخت آشكارساز كافي باشد). فاصلة مركز "صافي جاذب" تا كانون پرتو ايكس نيز cm ۷۵ بوده است. منحني تغييرات شدّت پرتو عبوري اندازه‌گيري شده بر حسب ضخامت "صافي جاذب" آلومينيومي نشان مي‌دهد كه HVL در ضخامت mmAl ۲/۴۲ اتفاق مي‌افتد (شكل ۳). ضخامت صافي ذاتي متناظر با اين مقدار HVL در ولتاژ kV ۶۰، با استفاده از منحني شكل ۲ معادل با mmAl ۳/۱۶ به دست آمده است. بنابراين مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه ضخامت صافي ذاتي مولّد پرتو ايكس مورد استفاده كمتر از حدّ اكثر مجاز mmAl ۳/۵ مي‌باشد و مي‌توان از آن براي توليد پرتوهاي ايكس مرجع استفاده كرد.

۴- توليد پرتوهاي ايكس مرجع در سطح پرتودرماني

مشخّصات پرتوهاي ايكس مرجع براي سنجه‌بندي مناسب دزيمترها در سطح پرتودرماني، در گزارش فني IAEI TRS # 374 مندرج



شكل ۲- تغييرات ضخامت صافي ذاتي نسبت به تغييرات HVL باريكة خروجي در ولتاژ kV ۶۰

تشكيل دهندة آن متغيّر است، ولي در ولتاژهاي بالا هم با توجّه به

شكل ۳- طريقة تعيين صافي ذاتي دستگاه مولّد ايكس Philips RT250

در واقع از آزمايشگاه ملّي فيزيك انگليس(NPL) اقتباس‌شده‌اند، گستره‌اي بين HVL = ۰/۰۲٤ mmAl تا HVL = ٤ mmCu را دربرمي‌گيرند. اين گسترة كيفيت، با اِعمال ولتاژهايي بين ۸/٥ kV تا ۲۸۰ kV و به كار بردن صافي‌هاي اضافي مناسب ايجاد شده است. نحوة تصفيه پرتوهاي ايكس در هر ولتاژ طوري انجام گرفته است كه نمودار كيفيت پرتوها برحسب تابعي از ولتاژ اِعمال شده، در مقياس لگاريتمي، خط راست باشد. اين روش مناسبترين شيوة انتخاب كيفيت‌هاي مرجع براي سنجه‌بندي دزيمترها، چه در سطح پرتودرماني و چه در سطح حفاظت در برابر پرتوها، شناخته شده است [٤].

با توجّه به اينكه دستگاه مولّد پرتو ايكس Philips RT250 تنها مي‌تواند اين پرتوها را در پنج ولتاژ ثابت بين ۷٥ kV و kV ۲٥۰ توليد كند، سعي شده است، پرتوهاي ايكس در هر ولتاژ طوري تصفيه شوند كه اوّلاً كيفيت پرتوهاي ايجاد شده در گسترة قابل قبول كيفيت پرتوهاي ايكس مرجع در سطح پرتودرماني قرار گيرند، ثانياً نرخ كِرماي هوا در مورد همة آنها در نقطة سنجه‌بندي تقريباً يكسان باشد [٤]. براي اندازه‌گيري كيفيت و نرخ كرماي هوا از اتاقك يونش استاندارد ثانوية NPL o.325cc NE2561 #117 در فاصلة ۱۰۰ سانتي‌متري كانون پرتو ايكس استفاده شده است. قطر ميدان پرتو در اين فاصله، هنگام اندازه‌گيري كيفيت پرتوها حدود cm ٤/۲ و هنگام اندازه‌گيري نرخ كِرماي هوا حدود cm ۱۱/۷ بوده است. نتايج اندازه‌گيريها، شامل اندازه‌گيريهاي مربوط به كيفيت و نرخ كِرماي هوا، تغييرات نرخ كِرماي هوا نسبت به تغييرات جريان لامپ مولّد پرتو ايكس، همچنين مقايسة نمودار كيفيت پرتوهاي توليد شده بر حسب تابعي از ولتاژ با گسترة ارائه شده توسّط IAEA، در جدول ۱ و شكل‌هاي ٤ و ٥ و ٦ نشان داده شده‌اند.

٥- توليد پرتوهاي ايكس مرجع در سطح حفاظت در برابر پرتوها

پرتوهاي ايكس مرجع تصفيه شده براي سنجه‌بندي دزيمترهاي مورد استفاده در حوزة حفاظت در برابر پرتوها، در چهار سري متمايز از هم در استاندارد ISO-4037-1 در جدول ۲ معرّفي شده‌اند: پرتوهاي سري L داراي باريكترين طيف و كمترين نرخ كِرماي هوا هستند و به شرط سازگار بودن با گسترة

جدول ۱- مشخّصات پرتوهاي ايكس مرجع توليد شده در سطح پرتودرماني

ولتاژ (kV)	شدّت جريان (mA)	صافي اضافي (mm)	كيفيت (HVL بر حسب mm)	ضريب همگني «h» (HVL1/HVL2)	انرژي مؤثّر* (keV)	نرخ كِرماي هوا** (mGy/min)
۷٥	۱۷	۰/۳۷٥ Al	۲/٦ Al	۰/٦۹	۳۳/٦۳	٤۹/٥۲
۱۰۰	۱۸	۳ Al	۰/۲ Cu	۰/٥٦	٤٤/٤۲	٤۹/۸۸
۱٥۰	۱۷	۰/٦ Cu + ۱ Al	۰/۸۹ Cu	۰/۷۰	۷۹/۰٦	٥۰/٦۹
۲۰۰	۱٦	۲/۱ Cu + ۱ Al	۲/۲٦ Cu	۰/۷۹	۱۲٥/٦	٤۹/٦٥
۲٥۰	۱۲	۱ Cu + ۱ Al + ۱ Sn	۳/٥ Cu	۰/۸۷	۱٥۹/۷٦	٥۰/۷۹

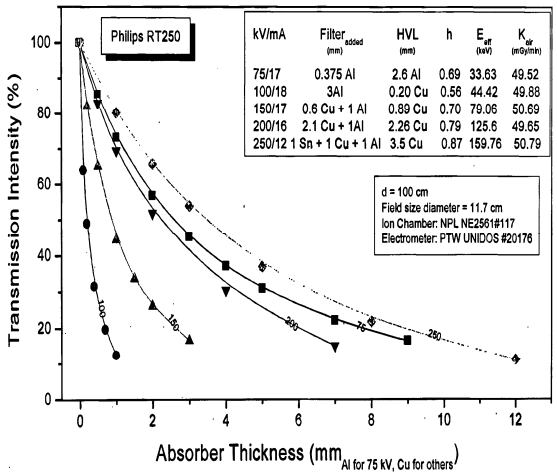
* منظور از انرژي مؤثّر پرتو ايكس ترمزي، انرژي يك باريكة ايكس (فوتون) تك انرژي است كه همان HVL پرتو ايكس ترمزي را داشته باشد. براي برآورد انرژي موثّر باريكه‌هاي ايكس، E_{eff}، ابتدا ضريب تضعيف هر باريكه از رابطة $\mu = 0.693/HVL$ حساب شده، سپس با مراجعه به داده‌هاي موجود [٥]، كه ضرايب تضعيف جرمي فوتون‌ها، يعني «μ/ρ» را در عناصر و مواد مختلف برحسب انرژي فوتون عرضه مي‌دارند، انرژي موثّر برآورد شده است.

**فاصله از کانون پرتو ایکس ۱۰۰ cm، قطر میدان پرتو ۱۱/۷ cm.

جدول ۲- مشخّصات کلی پرتوهای پیوستهٔ ایکس مرجع (ISO-4037)

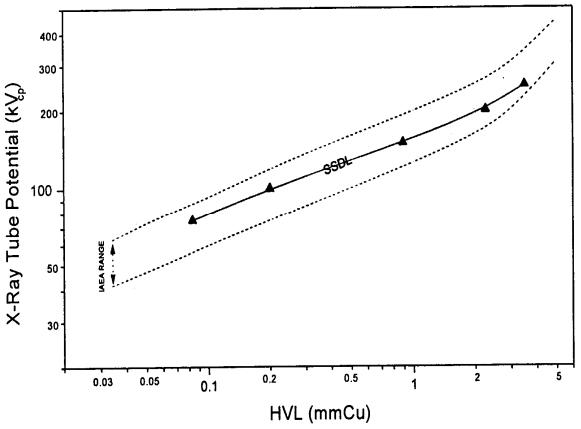
نام سری	گسترهٔ کیفیت HVL (mm)	ضریب همگنی (h=HVL1/HVL2)	نرخ کرمای هوا (Gy/h*)
نرخ پایین کرمای هوا (L)	۰/۰۵۸ Al – ۵/۲۶ Cu	۱/۰	۳× ۱۰$^{-۴}$
طیف باریک (N)	۰/۰۴۷ Al – ۶/۱۲ Cu	۰/۷۵ – ۱/۰	۱۰$^{-۳}$ – ۱۰$^{-۲}$
طیف پهن (W)	۰/۱۸ Cu – ۵/۲۰ Cu	۰/۶۷ – ۰/۹۸	۱۰$^{-۲}$ – ۱۰$^{-۱}$
نرخ بالای کرمای هوا (H)	۰/۰۳۶ Al – ۳/۴ Cu	۰/۶۴ – ۰/۸۶	۱۰$^{-۱}$ – ۰/۵

*در فاصلهٔ ۱ متری و جریان ۱ mA

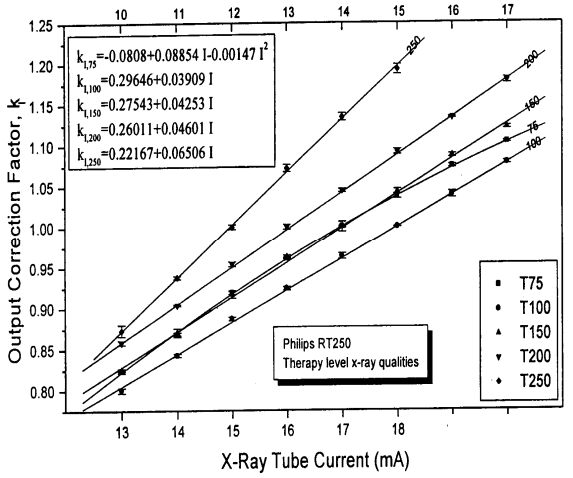


شکل ٤- نمودار تغییرات شدّت عبور پرتو بر حسب ضخامت صافی جاذب برای تعیین کیفیت باریکه‌های ایکس مرجع در سطح پرتودرمانی در ولتاژهای مختلف با صافی‌های اضافی معیّن

شکل ٥- تغییرات ضریب‌های تصحیح خروجی پرتوهای ایکس در سطح پرتودرمانی بر حسب جریان لامپ. نتایج اندازه‌گیری برای ولتاژهای ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ kV به ترتیب در جریان‌های ۱۷، ۱۸، ۱۷ و ۱۶ میلی آمپر (مقیاس پایین شکل) و برای ۲۵۰ kV در ۱۲ میلی آمپر (مقیاس بالای شکل) بهنجار شده‌اند.



شکل ٦- مقایسهٔ کیفیت پرتوهای ایکس تولید شده در سطح پرتودرمانی با گسترهٔ قابل قبول کیفیت پرتوهای ایکس معرّفی شده توسّط (IAEA)



اندازه‌گیری دُزیمتر مورد آزمون، باید برای تعیین پاسخ آن برحسب انرژی فوتون به کار روند. در مقابل، پرتوهای سری H، پهن‌ترین طیف و بیشترین نرخ کرمای هوا را دارند و برای تعیین ویژگیهای خارج از ظرفیت اندازه‌گیری (گرانباری) [٥] بعضی دزیمترها مناسب هستند.

با توجّه به محدوديت ولتاژهاي موجود دستگاه Philips RT250، تنها بخشي از پرتوهاي سري N، W و H، از ولتاژ ۷۵ kV به بالا، توليد شده و به علّت اختلاف اكثر ولتاژهاي بكار رفته در ISO-4037-1 با ولتاژهاي موجود و در دسترس نبودن صافي‌هاي اضافي مناسب، از توليد سري طيف L صرفنظر شده است. مشخّصات پرتوهاي ايكس توليد شدة سري N، W و H در جدول ۳ درج و در شكل‌هاي ۷، ۱۰ و ۱۳ نشان داده شده‌اند. اندازه‌گيري نرخ كِرماي هوا در مورد پرتوهاي ايكس سري‌هاي N و W در فاصلة ۳ متري از كانون پرتو ايكس و با استفاده از اتاقك يونش كروي نوع 1000cc, LS01 انجام گرفته و قطر ميدان پرتو در اين فاصله تقريباً ۲٤ cm بوده است. در مورد پرتوهاي ايكس سري H، اندازه‌گيري نرخ كِرماي هوا در ولتاژهاي ۷۵ kV و ۱۰۰ kV با استفاده از اتاقك يونش NE2561, NPL, 0.325cc, در فاصلة ۷۵ cm، و در ولتاژهاي ۲۰۰ kV و ۲۵۰ kV با استفاده از اتاقك يونش LS01 در فاصلة ۲۲۵ cm صورت گرفته است ۱۲ براي تخمين E_{eff}، يعني انرژي موثّر باريكه‌هاي ايكس، ابتدا ضريب تضعيف هر باريكه با استفاده از رابطة $\mu = 0.693/HVL$ حساب شده، سپس به كمك داده‌هاي موجود [٥]، كه ضرايب تضعيف جرمي فوتون‌ها، (μ/ρ)، را در عناصر و مواد مختلف برحسب انرژي فوتون ارائه مي‌دهند، انرژي مؤثّر برآورد شده است.

براي سنجه‌بندي دُزيمترهاي محيطي و فردي بر حسب واحدهاي عملي معادل دُز $H^*(d)$، $H'(d,\Omega)$، و $H_p(d)$، لازم است كِرماي هوا را تحت شرايط معيّني به معادل دُز تبديل كنيم. براي اين منظور در استاندارد ISO 4073-3، ضريبهاي تبديل كِرماي هوا (Gy) به معادل دُز (Sv) بر حسب انرژي ميانگين طيف پرتوهاي ايكس مرجع عرضه شده‌اند [٦]. با استفاده از روش درونيابي اين داده‌ها، ضريب‌هاي تبديل مذكور براي پرتوهاي ايكس توليد شده، بر حسب انرژي مؤثّر هر باريكه حساب و در جدول ٤ درج شده‌اند. در مورد پرتوهاي ايكس طيف‌هاي N و W، چون درجة همگني آنها بالا است، انرژي‌هاي ميانگين و مؤثّرشان نزديك به هم هستند؛ به همين جهت از انرژي مؤثّر حساب شده براي برآورد ضرايب تبديل كِرما به معادل دُز استفاده شده است. در مورد پرتوهاي ايكس طيف H، انرژي بكار رفته، انرژي مؤثّر متناظر با انرژي ميانگين هر باريكه است.

نمودارهاي تغييرات نسبي "نرخ كِرماي هوا" براي پرتوهاي ايكس توليد شده بر حسب تابعي از جريان لامپ، همچنين مقايسة كيفيت اين پرتوها با كيفيت‌هاي استاندارد ISO-4037-1، برحسب تابعي از ولتاژهاي بكار رفته، در شكل‌هاي ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱٤ و ۱۵ نشان داده شده‌اند. كاهش نسبي "نرخ كِرماي هوا" در ولتاژهاي kV ۷۵ و kV ۱۰۰ در سري N با افزايش جريان جالب توجّه است (شكل ۸). اين كاهش احتمالاً در نتيجة اُفت كيفيت پرتو بر اثر افزايش جريان در يك ولتاژ ظاهراً ثابت رخ مي‌دهد. به عبارت ديگر، طيف فوتونهاي توليد شده در يك ولتاژ ثابت و صافي اضافي معيّن، هنگام افزايش جريان لامپ به سمت انرژي‌هاي پايين‌تر سوق داده مي شود. در نتيجه تعداد نسبي فوتونهاي جذب شده در صافي اضافي، با افزايش جريان زيادتر شده و سبب مي‌شود كه آهنگ افزايش "نرخ كِرماي هوا" به ازاي افزايش جريان لامپ در ولتاژهاي بالاتر از kV ۱۰۰، كند شود و در ولتاژهاي kV ۷۵ و kV ۱۰۰ با صافي‌هاي اضافي، به

جدول ۳- مشخّصات پرتوهاي ايكس مرجع توليد شده در سطح حفاظت در برابر پرتوها

نام طیف	ولتاژ (kV)	جریان (mA)	صافی اضافی (mm)	کیفیت پرتو (HVL در mmCu)	ضریب همگنی (HVL1/HVL2)	انرژی مؤثر (keV)	نرخ کرمای هوا * (mGy/h)
N	۷۵	۱۵	Cu + ۱ Al ۱/۶	۰/۵۰۸	۰/۹۸	۶۳/۲	۳/۴۸۷۸
	۱۰۰	۱۵	Cu + ۱ Al ۵	۱/۱۱۶	۰/۹۲	۸۶/۲	۱/۵۴۴۴
	۱۵۰	۱۵	Sn + ۱ Al ۲/۵	۲/۴۳۸	۰/۹۲	۱۳۰/۳	۱۴/۷۱۳۸
	۲۰۰	۱۵	Sn + ۱ Al ۱ Pb + ۱	۴/۰۰	۰/۹۸	۱۷۱/۲	۱۱/۹۷۹
	۲۵۰	۱۲	Sn + ۱ Al ۲/۵ Pb +۱	۵/۳۶	۰/۹۸	۲۲۹/۸	۹/۲۶۷۶
W	۷۵	۱۶	Cu + ۱ Al ۰/۴	۰/۳۲۳	۰/۹۱	۵۳/۳	۳۷/۳۳۲
	۱۰۰	۱۶	Cu + ۱ Al ۱/۵	۰/۷۵۴	۰/۸۹	۷۴/۴	۲۴/۸۵۲
	۱۵۰	۱۶	Sn + ۱ Al ۱	۱/۸۹۱	۰/۸۸	۱۱۳/۴	۶۴/۷۷۶
	۲۰۰	۱۶	Sn + ۱ Al ۲	۳/۲۴۲	۰/۹۰	۱۵۳/۸	۱۱۸/۲۳
	۲۵۰	۱۲	Sn + ۱ Al ۴	۴/۵۲۲	۰/۹۶	۱۹۳/۲	۱۱۱/۲۸۲
H	۷۵	۱۶	Cu + ۱ Al ۰/۱	۰/۱۸۰	۰/۶۹	۴۲/۴	۱۹۳۰/۸
	۱۰۰	۱۶	Cu + ۱ Al ۰/۲	۰/۳۴۶	۰/۷۳	۵۴/۱۶	۳۰۳۴/۸
	۲۰۰	۱۶	Cu + ۱ Al ۱/۱	۱/۷۰	۰/۶۹	۱۰۶/۶۰	۸۷۶/۶
	۲۵۰	۱۲	Cu + ۱ Al ۱/۶	۲/۵۶۴	۰/۷۳	۱۳۴/۵	۱۰۲۰/۶

*

اندازه‌گیری نرخ کرمای هوا در مورد پرتوهای ایکس سری‌های N و W، در فاصلهٔ ۳ متری از کانون پرتو ایکس به وسیلهٔ اتاقک یونش کروی نوع LS01 1000 cc انجام گرفته و قطر میدان پرتو در این فاصله تقریباً ۲۴ cm بوده است. در مورد پرتوهای ایکس سری H، اندازه‌گیری نرخ کرمای هوا در ولتاژهای ۷۵ kV و ۱۰۰ kV با استفاده از اتاقک یونش NPL, 0.325 cc, NE2561 در فاصلهٔ ۷۵ cm، و در ولتاژهای ۲۰۰ kV و ۲۵۰ kV با استفاده از اتاقک یونش LS01 در فاصلهٔ ۲۲۵ cm صورت گرفته است.

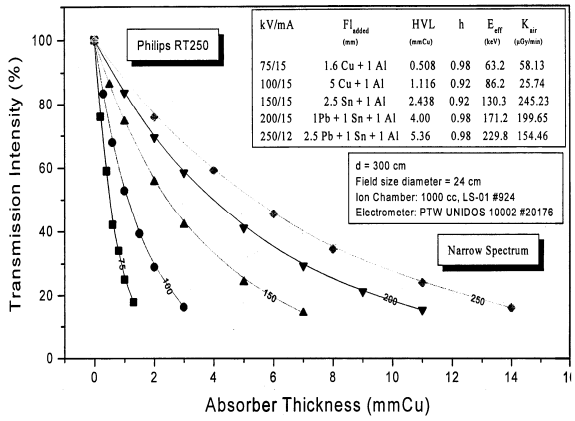
جدول ۴- ضریب‌های تبدیل کرمای هوا به واحدهای معادل دُز محیطی و فردی در شرایط تابش عمودی پرتوهای ایکس مرجع تولید شده

نام طیف	کیفیت پرتو (HVL در mmCu)	انرژی مؤثر E_{eff}(keV)	ضریب تبدیل کرمای هوا به معادل دُز، (Sv/Gy)				
			$H'(0.07)/K_a$	$H^*(10)/K_a$	فانتوم تخت* (Slab)		فانتوم ستونی* (Pillar)	فانتوم میله‌ای* (Rod)
					$H_p(0.07)/K_a$	$H_p(10)/K_a$	$H_p(0.07)/K_a$	$H_p(0.07)/K_a$
N	۰/۵۰۸	۶۳/۲	۱/۵۹	۱/۷۳	۱/۷۱	۱/۸۷	۱/۳۹	۱/۱۴
	۱/۱۱۶	۸۶/۲	۱/۵۹	۱/۷۰	۱/۷۱	۱/۸۷	۱/۳۷	۱/۱۷
	۲/۴۳۸	۱۳۰/۳	۱/۴۷	۱/۵۴	۱/۵۷	۱/۶۸	۱/۳۰	۱/۱۷
	۴/۰۰	۱۷۱/۲	۱/۳۸	۱/۴۴	۱/۴۸	۱/۵۵	۱/۲۶	۱/۱۶
	۵/۳۶	۲۲۹/۸	۱/۳۲	۱/۳۷	۱/۴۰	۱/۴۵	۱/۲۳	۱/۱۴
W	۰/۳۲۳	۵۳/۳	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۵۹	۱/۷۰	۱/۳۴	۱/۱۲
	۰/۷۵۴	۷۴/۴	۱/۵۹	۱/۷۱	۱/۷۱	۱/۸۷	۱/۳۸	۱/۱۵
	۱/۸۹۱	۱۱۳/۴	۱/۵۰	۱/۵۸	۱/۶۱	۱/۷۳	۱/۳۲	۱/۱۶
	۳/۲۴۲	۱۵۳/۸	۱/۳۹	۱/۴۷	۱/۵۰	۱/۵۸	۱/۲۸	۱/۱۵
	۴/۵۲۲	۱۹۳/۲	۱/۳۵	۱/۴۰	۱/۴۳	۱/۴۹	۱/۲۴	۱/۱۵
H	۰/۱۸۰	۴۲/۴	۱/۴۰	۱/۴۱	۱/۴۷	۱/۴۹	۱/۲۸	۱/۱۰
	۰/۳۴۶	۵۴/۱۶	۱/۵۰	۱/۵۸	۱/۵۹	۱/۶۹	۱/۳۳	۱/۱۳
	۱/۷۰	۱۰۶/۶۰	۱/۴۹	۱/۵۹	۱/۶۰	۱/۷۲	۱/۳۲	۱/۱۶
	۲/۵۶۴	۱۳۴/۵	۱/۴۳	۱/۵۱	۱/۵۳	۱/۶۳	۱/۲۹	۱/۱۶

*فانتوم‌های استاندارد مورد استفاده برای سنجه‌بندی دزیمترهای فردی: ۱) فانتوم تخت (آب)، نمایانگر تمام بدن، به ابعاد ۱۵ cm × ۳۰ cm × ۳۰ cm. دیواره‌های فانتوم از جنس پرپکس (PMMA) به ضخامت ۱۰ mm (بجز صفحهٔ جلویی با ضخامت ۲/۵mm).

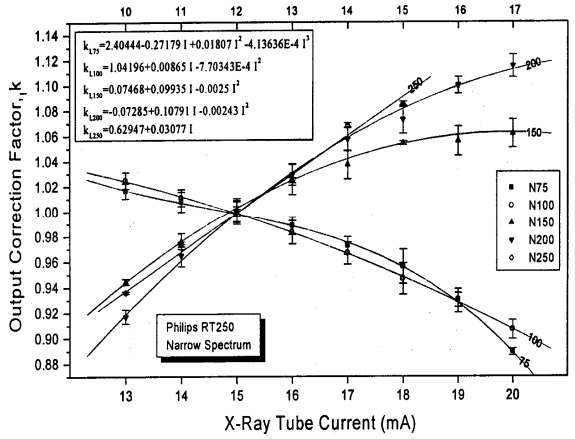
۲) فانتوم ستوني (آب)، نمايانگر ساعد يا ساق پا، استوانه‌اي به قطر ۷۳mm و به طول ۳۰۰mm. جنس ديواره‌ها PMMA، ضخامت مدور ۲/۵mm، انتها ۱۰ mm .

۳) فانتوم ميله‌اي نمايانگر انگشت از جنس PMMA به قطر ۱۹ mm و به طول ۳۰۰ mm .

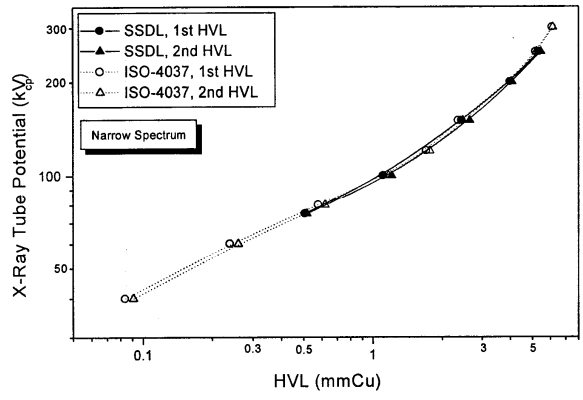


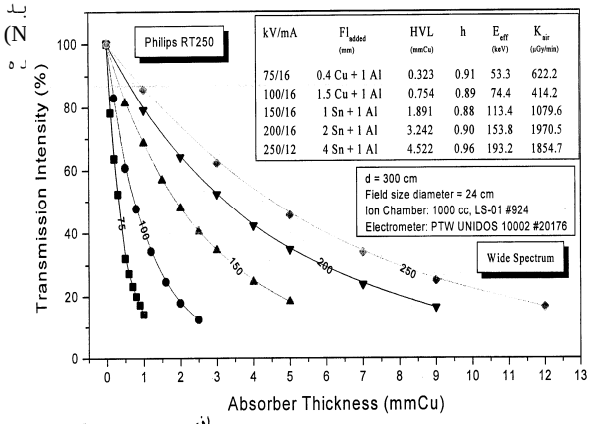
kV/mA	Fl_{added} (mm)	HVL (mmCu)	h	E_{eff} (keV)	K_{air} (μGy/min)
75/15	1.6 Cu + 1 Al	0.508	0.98	63.2	58.13
100/15	5 Cu + 1 Al	1.116	0.92	86.2	25.74
150/15	2.5 Sn + 1 Al	2.438	0.92	130.3	245.23
200/15	1Pb + 1 Sn + 1 Al	4.00	0.98	171.2	199.65
250/12	2.5 Pb + 1 Sn + 1 Al	5.36	0.98	229.8	154.46

شكل ۷- نمودار تغييرات نسبي شدّت پرتو بر حسب ضخامت صافي جذبكننده براي تعيين كيفيت باريكه‌هاي پرتو ايكس مرجع داراي طيف باريك (Narrow Spectrum) در ولتاژهاي مختلف با صافي اضافي معيّن



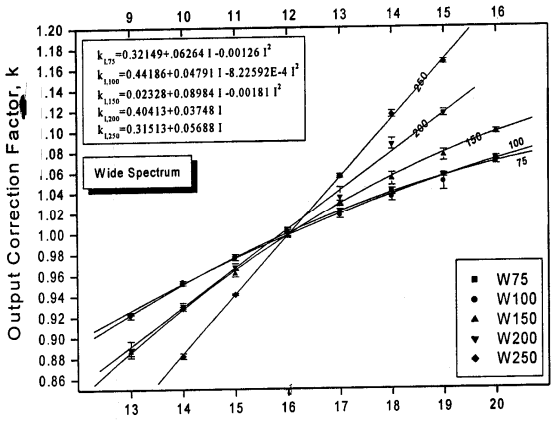
شكل ۸- تغييرات خروجي پرتوهاي ايكس سري طيف باريك (Narrow Spectrum) بخش SSDL بر حسب جريان لامپ. نتايج اندازه‌گيري براي پرتوهاي N75-N200 در جريان ۱۵ mA (مقياس پايين شكل) و براي N250 در جريان ۱۲ mA (مقياس بالاي شكل) بهنجار شده‌اند.



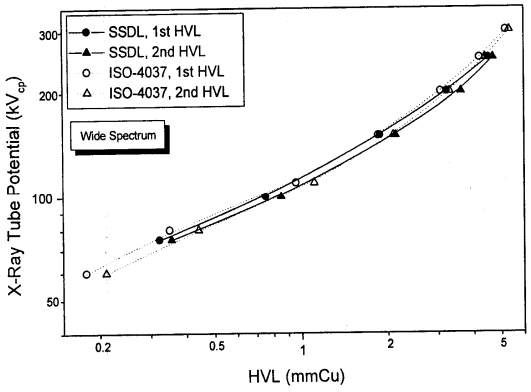


kV/mA	Fl_{added} (mm)	HVL (mmCu)	h	E_{eff} (keV)	K_{air} (μGy/min)
75/16	0.4 Cu + 1 Al	0.323	0.91	53.3	622.2
100/16	1.5 Cu + 1 Al	0.754	0.89	74.4	414.2
150/16	1 Sn + 1 Al	1.891	0.88	113.4	1079.6
200/16	2 Sn + 1 Al	3.242	0.90	153.8	1970.5
250/12	4 Sn + 1 Al	4.522	0.96	193.2	1854.7

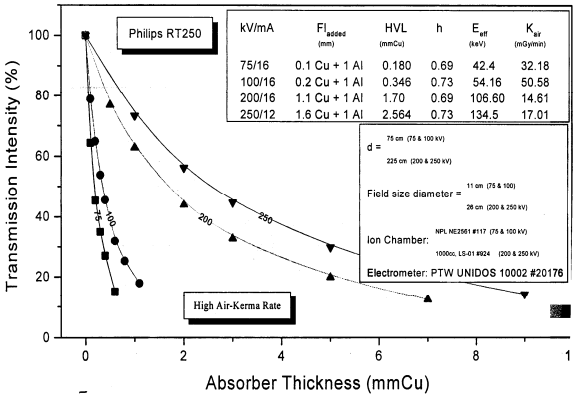
شكل ۱۰- نمودار تغييرات نسبي شدّت عبور پرتو اندازه‌گيري شده برحسب ضخامت صافي جاذب براي باريكه‌هاي پرتو ايكس مرجع طيف پهن (Wide Spectrum) بخش SSDL در ولتاژهاي مختلف با صافي اضافي معيّن.



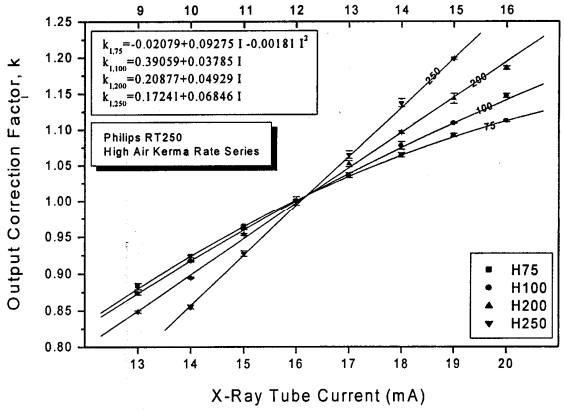
شكل ۱۱- تغييرات خروجي پرتوهاي ايكس دستة طيف پهن(Wide Spectrum) بخش SSDL بر حسب جريان لامپ. نتايج اندازه‌گيري براي پرتوهاي W75 تا W200 در جريان ۱۶ mA (مقياس پايين شكل) و براي W250 در ۱۲ mA (مقياس بالاي شكل) بهنجار شده‌اند.



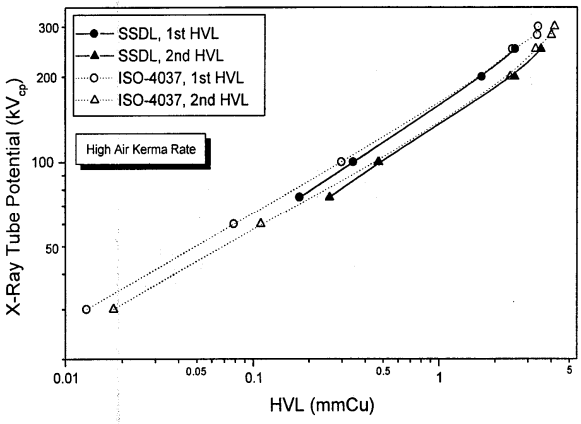
شکل ۱۲- مقایسة کیفیت پرتوهای ایکس تولید شده دسته طیف پهن (Wide Spectrum) بخش SSDL با پرتوهای معرّفی شده در استاندارد ISO-4037-1..



شکل ۱۳- نمودار تغییرات نسبي شدّت عبور پرتو اندازه‌گیري شده بر حسب ضخامت صافي جاذب براي باریکه‌هاي پرتو ایکس مرجع با نرخ کرماي هوا (High Air Kerma Rate Series) بخش SSDL با ولتاژهاي مختلف و صافي اضافي معیّن



شکل ۱٤- تغییرات خروجي پرتوهاي ایکس با نرخ بالاي کرماي هوا (High Air Kerma Rate Series) بخش SSDL بر حسب جریان لامپ. نتایج اندازه‌گیري براي پرتوهاي H75 تا H200 در جریان ۱٦ mA (مقیاس پایین شکل) و براي H250 در ۱۲ mA (مقیاس بالاي شکل) بهنجار شده‌اند.



شکل ۱۵- مقایسة کیفیت پرتوهاي ایکس تولید شده با نرخ بالاي کرماي هوا (High Air Kerma Rate Series) بخش SSDL با پرتوهاي معرّفي شده در استاندارد ISO-4037-1..

ترتیب بیشتر از ۱/۲ mmCu و ٤ mmCu، ابتدا متوقف گردیده سپس حتّي کاهش یابد. این پدیده در دستگاه مولّد پرتو ایکس دیگر از نوع hilips RT250 هم مشاهده شده، ولي در دستگاه مولّد پرتو ایکس از نوع ISOVOLT IV، که قابلیت تغییر پیوستة ولتاژ و جریان دارد، این اثر بسیار کمتر دیده شده و بي‌اهمیّت بوده است.

٦- بررسي خطاها و تأثیر پراکندگي پرتو

ارزیابي خطاي کلّي[٦] در تعیین "نرخ کرماي هوا" براساس استاندارد ISO/TAG 4/WG3 صورت گرفته است [۷]. بر این اساس خطاي کلّي در تعیین "نرخ کرماي هوا" در مورد باریکه‌هاي پرتو ایکس تولید شده در سطح پرتودرماني در نقطة سنجه‌بندي (۱۰۰ cm) و دو باریکة H75 و H100[*] (در ۷۵ cm)، با در نظر گرفتن خطاي فاکتور سنجه‌بندي اتاقك یونش NPL NE2561 در کیفیت باریکه‌هاي پرتو ایکس مورد نظر (±%۱/۲)، خطاي تنظیم مرکز اتاقك یونش در نقطة سنجه‌بندي (±۱mm)، خطاي تعیین دماي محیط اندازه‌گیري (±۱°C)، خطاي تعیین فشار هوا (±۱mb)، انحراف معیار مقادیر خوانده شده الکترومتر هنگام اندازه‌گیري (±%۰/٥) و همچنین با در نظرگرفتن ضریب پوششي[۷] k = ۲/٥، در حدود %۳/٥ برآورد شده است. به همین طریق، خطاي کلّي در تعیین نرخ کرماي هواي باریکه‌هاي پرتو ایکس تولید شده در سطح حفاظت در برابر اشعه (بجز H75 و H100) در نقطة سنجه‌بندي (۳۰۰ cm)، با در نظر گرفتن خطاي فاکتور سنجه‌بندي اتاقك یونش LS 01 در تعیین کیفیت باریکه‌هاي پرتو ایکس مورد نظر

(۱%)، خطاي تنظيم مركز اتاقك يونش در نقطة سنجه‌بندي (cm ۰/۵±)، خطاي تعيين دما و فشار هواي محيط اندازه‌گيري (به ترتيب ۱°C± و ۱mb±)، انحراف معيار مقادير خوانده شدة الكترومتر هنگام اندازه‌گيري (۱%±)، همچنين با در نظر گرفتن ضريب پوششي ۲/۵= k، جمعاً حدود ٤% برآورد شده است.

براي ارزيابي سهم پراكندگي پرتو در باريكه‌هاي اصلي پرتوهاي ايكس توليد شده، بنا بر توصية ISO-4037-1، نرخ كِرماي هوا در فواصل مختلف از كانون اين پرتوها واقع بر محور مركزي، در همة باريكه‌هاي مرجع توليد شده، در سطوح پرتودرماني و حفاظت در

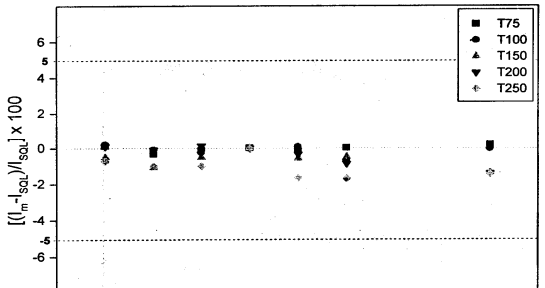
* منظور از H75 و H100، باريكة طيف H در ج ولتاژ ۷۵ kV و ۵۵ kV است.

۱۵

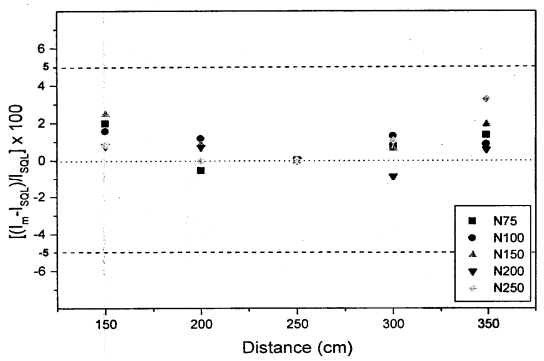
با مقادير حساب شده به نسبت عكس مجذور فاصله از نقاط سنجه‌بندي مقايسه گرديده‌اند. اختلاف نسبي نتايج اندازه‌گيري با مقادير حساب شده در همة موارد از ۵%، (حدّاكثر اختلاف قابل قبول در استاندارد مذكور) همواره كمتر بوده است. شكل‌هاي ۱٦ و ۱۷ نتايج اين اندازه‌گيريها را به ترتيب در مورد پرتوهاي ايكس مرجع در سطح پرتودرماني و پرتوهاي ايكس مرجع طيف باريك[۸] نشان مي‌دهند.

۷- نتيجه گيري

تأمين ميدانهاي مرجع پرتوهاي يونساز از اهمّ ضروريات يك آزمايشگاه دزيمتري استاندارد به شمار مي‌رود. در اين مقاله، نحوة توليد پرتوهاي تصفيه شدة ايكس مرجع، در سطوح پرتودرماني و حفاظت در برابر پرتوها، به وسيلة دستگاه مولّد پرتو ايكس از نوع Philips RT250 و براساس استانداردهاي بين‌المللي موجود شرح داده شده است. با توجّه به محدود بودن ولتاژهايي كه در دسترسند، تنها بخشي از پرتوهاي ايكس مرجع



شكل ۱٦- درصد انحراف خروجي اندازه‌گيري شدة پرتوهاي ايكس توليد شده در سطح پرتودرماني در فواصل مختلف (I_m) از مقادير خروجي محاسبه شده به نسبت عكس مجذور فاصله (I_{SQL}) از نقطة



شكل ۱۷- درصد انحراف خروجي اندازه‌گيري شدة پرتوهاي ايكس توليد شده طيف N در فواصل مختلف (I_m) از مقادير محاسبه شده خروجي به نسبت عكس مجذور فاصله (I_{SQL}) از نقطة ي سنجه‌بندي (۲۵۰ cm).

چناچه يك، يا ترجيحاً دو دستگاه مولّد پرتو ايكس (يكي بر ۱٦ ولتاژهاي كمتر از ۱۰۰ kV و ديگ براي ولتاژهاي ۳۰۰kV - ۱۰۰) با قابليت تغيير پيوستة ولتاژ و جريان، همچنين امكانات طيفسنجي و نصب اتاقك يونش ناظر[۹] در مسير پرتو تأمين شوند، مي‌توان به باريكه‌هاي پرتو ايكس به مراتب مطلوبتري از لحاظ گسترة انرژي و انطباق با باريكه‌هاي استاندارد دست يافت.

پي‌نوشت‌ها :

۱ - Kerma
۲ - Bremsstrahlung
۳ - Radiators
٤ - **HVL:** (Half Value Layer)
۵ - Overload
٦ - Overall Uncertainty
۷ - Coverage Factor
۸ - Narrow Spectrum
۹ - Monitor Chamber

References:

1. International Atomic Energy Agency, “Calibration of Radiation Protection Monitoring Instruments,” IAEA Safety Reports Series No. 16 (2000).

2. International Atomic Energy Agency, “Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy,” IAEA Technical Reports Series No. 374 (1994).

3.International Standards Organization, X and Gamma Reference Radiations for Calibrating Dose Meters and Dose Rate Meters and for Determining Their Response as a Function Photon Energy – Characteristics of the Radiations and their Methods of Production, ISO Standard 4037-1,Geneva (1995).

4. J. E. Burns, X-Ray Calibration Qualities, IAEA SSDL Newsletter, No. 39, July (1998).

5. F. M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams & Wilkins, Baltimore (1984).

6. International Standards Organization, “Reference Photon Radiations – Calibration of Area and Personnel Dosemeters and the Determination of their Response as a Fuction of Energy and Angle of Incidence,” ISO/DIS 4037-3, Geneva (1995).

7.International Standards Organization, “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement,” ISO/G4/WG3, Geneva (1992).